[A] TIIVISTELMĀ - SAMMANDRAG



(11) (21) Patenttihakemus - Patentansõkan

(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6

G 01N 21/43

(22) Hakemispāivā - Ansökningsdag 30.01.1998

(24) Alkupāivā - Lõpdag 30.01.1998

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 31.07.1999

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Janesko Oy, Elannontie 5, 01510 Vantaa, (FI)

(72) Keksijā - Uppfinnare

1. Salo, Harri, Vāhāntuvantie 2 A 1, 00390 Helsinki, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki

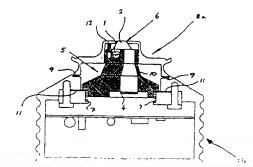
(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Refraktometri Refraktometer

(57) Tiivistelmā - Sammandrag

Keksinnön kohteena on refraktometri, joka kāsittāā runkorakenteeseen sovitetun valolähteen (1), prosessiliuokseen (3) sijoitettavan optisen ikkunan (2), välineet sādekimpun ohjaamiseksi valolāhteeltā optisen ikkunan (2) ja prosessiliuoksen (3) rajapintaan, jolloin osa sädekimpusta imeytyy osittain liuokseen (3) ja osa heijastuu kokonaan takaisin liuoksesta (3) muodostaen kuvan, jossa valoisan ja pimeän alueen rajan paikka riippuu prosessiliuoksen (3) taitekertoimesta sekä valodetektorin (4), jolla tarkastellaan edellä mainitulla tavalla muodostunutta kuvaa. Optisen ikkunan kulmamuutosten eliminoimiseksi valolāhde (1), optinen ikkuna (2), vālineet sädekimpun ohjaamiseksi ja valodetektori (4) on sovitettu jäykkään analysaattorimoduliin (5), joka on sovitettu kelluvasti runkorakenteen ja optisen ikkunan (2) văliin sovitetun tiivistyksen (6) varaan.

Uppfinningen avser en refraktometer, som omfattar en i en ramstruktur anpassad ljuskålla (1), ett optiskt fönster (2) placerat i en processlösning (3), don för styrning av ett strålknippe från ljuskållan till grånszonen mellan det optiska fönstret (2) och processlösningen (3), varvid en del av strålknippet till en del absorberas i lösningen (3) och en del helt reflekteras från lösningen (3) och alstrar en bild, där det ljusa och mörka områdets gråns beror på processlösningens (3) brytningsfaktor, samt en ljusdetektor (4), med vilken sagda bild betraktas. För att eliminera det optiska fönstrets vinkelförändringar är ljuskällan (1), det optiska fönstret (2), donet för styrning av strålknippet och ljusdetektorn (4) anpassade i en styv analysatormodul (5), vilken är anpassad flytande på en tätning (6) mellan ramstrukturen och det optiska fönstret (2).



Refraktometri

5

10

15

20

30

35

Keksinnön kohteena on refraktometri, joka käsittää runkorakenteeseen sovitetun valolähteen, prosessiliuokseen sijoitettavan optisen ikkunan, välineet sädekimpun ohjaamiseksi valolähteeltä optisen ikkunan ja prosessiliuoksen rajapintaan, jolloin osa sädekimpusta imeytyy osittain liuokseen ja osa heijastuu kokonaan takaisin liuoksesta muodostaen kuvan, jossa valoisan ja pimeän alueen rajan paikka riippuu prosessiliuoksen taitekertoimesta sekä valodetektorin, jolla tarkastellaan edellä mainitulla tavalla muodostunutta kuvaa.

Refraktometrin toimintaperiaate on ollut tunnettu jo yli sata vuotta. Nykyään refraktometrejä käytetään varsin paljon monilla eri aloilla. Esimerkkeinä refraktometrin käyttöaloista voidaan mainita elintarviketeollisuus, puunjalostusteollisuus, kemian teollisuus ja erilaiset tutkimukset yleensä.

Refraktometrin toimintaperiaatetta voidaan kuvata periaatteellisesti seuravalla tavalla. Refraktometri mittaa prosessiliuoksen taitekerrointa optisen ikkunan ja liuoksen rajapinnassa syntyvän kokonaisheijastuksen avulla. Valolähteestä tuleva sädekimppu ohjataan optisen ikkunan ja prosessiliuoksen rajapintaan. Osa sädekimpusta heijastuu kokonaan liuoksesta, osa imeytyy osittain liuokseen. Tästä aiheutuu kuva, jossa valoisan ja pimeän alueen rajan paikka riippuu kokonaisheijastuksen rajakulmasta ja siis prosessiliuoksen taitekertoimesta.

Refraktometrimittauksen olennaisena seikkana on valon heijastumisesta aiheutuvan kuvan analysointi. Em. kuva-analyysin tarkoituksena on löytää kokonaisheijastuksen rajakulma, siis toisin sanoen raja, jossa edellä esitetyllä tavalla muodostuvan kuvan valoisa alue muuttuu pimeäksi alueeksi.

Kuten edellä esitetyistä seikoista tulee esille,

refraktometrin toiminta perustuu erittäin tarkkaan kulmanmittaukseen, koska kokonaisheijastuksen rajakulma määräytyy kahden aineen taitekertoimen mukaan. Tunnetuissa refraktometreissä on usein ollut ongelmana optisen ikkunan kulmanmuutokset laitteen runkotakenteeseen nähden, koska optinen ikkuna on usein kiinnitetty runkorakenteeseen joustavan tiivistemateriaalin avulla. Mikäli optinen ikkuna on kiinnitetty jäykästi runkorakenteeseen, tiivistemateriaalin pitää olla hyvin elastinen ja näin ollen tiettyjä heikosti elastisia materiaaleja kuten teflonia ei voida käyttää. Useissa tunnetuissa refraktometreissä optiikka ja valodetektori on kiinnitetty jäykästi runkoon, joten toisen ongelman aiheuttaa runkorakenteen vääntymisestä aiheutuva kulmamittauksen virhe.

Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan refraktometri, jonka avulla aiemmin tunnetun tekniikan epäkohdat pystytään eliminoimaan. Tähän on päästy keksinnön mukaisen refraktometrin avulla, joka on tunnettu siitä, että valolähde, optinen ikkuna, välineet sädekimpun ohjaamiseksi ja valodetektori on sovitettu jäykkään analysaattorimoduliin, joka on sovitettu kelluvasti runkorakenteen ja optisen ikkunan väliin sovitetun tiivistyksen varaan.

Keksinnön mukaisen ratkaisun etuna on se, että kelluvan jäykän analysaattorimodulin vuoksi optisen ikkunan joustava kiinnitys on mahdollista myös heikosti elastisen tiivisteen avulla kulmamittaustarkkuuden kärsimättä. Keksinnön mukainen refraktometri on myös rakenteeltaan yksinkertainen, joten keksinnön käyttönotto muodostuu edulliseksi. Keksinnön mukainen refraktometri on lisäksi käytössä hyvin joustava, sillä se voidaan asentaa hyvin monella tavalla esimerkiksi prosessiputkistoon.

Keksintöä ryhdytään selvittämään seuraavassa tarkemmin oheisessa piirustuksessa esitettyjen esimerkkien avulla, jolloin

kuvio 1 esittää periaatteellisena kaaviokuvantona

35

5

10

15

20

25

refraktometrin toimintaperiaatetta,

kuvio 2 esittää keksinnön mukaisen refraktometrin erään sovellutusmuodon rakennetta periaatteellisena leik-kauskuvantona ja

kuviot 3 - 5 esittävät esimerkkejä keksinnön mukaisen refraktometrin erilaisista asennusmahdollisuuksista.

Kuviossa 1 on esitetty refraktometrin toimintaperiaate periaatteellisena kaaviokuvantona. Viitenumeron 1 avulla on merkitty valolähde ja viitenumeron 2 avulla optinen ikkuna, joka voi olla esimerkiksi prisma. Viitenumeron 3 avulla on merkitty prosessiliuos.

Kuten aiemmin on jo todettu refraktometri mittaa prosessiliuoksen taitekerrointa optisen ikkunan 2 ja prosessiliuoksen 3 rajapinnassa syntyvän kokonaisheijastuksen avulla. Refraktometrin toimintaperiaate on alan ammattihenkilölle täysin tunnettua tekniikkaa, joten ko. seikkoihin ei perehdytä tarkemmin tässä yhteydessä. Tässä yhteydessä kuvataan ainoastaan olennainen perusperiaate.

Valolähteestä 1 tuleva sädekimppu ohjataan optisen ikkunan 2 ja prosessiliuoksen 3 rajapintaan. Sädekimppu on kuvattu kuviossa 1 periaatteellisesti nuolten avulla. Osa sädekimpusta heijastuu kokonaan takaisin prosessiliuoksesta 3, osa imeytyy osittain luokseen. Tästä aiheutuu kuva K, jossa valoisan alueen A ja pimeän alueen B rajan C paikka riippuu kokonaisheijastuksen rajakulmasta ja siis prosessiliuoksen taitekertoimesta.

Refraktometrin toiminta perustuu siis erittäin tarkkaan kulmamittaukseen, koska kokonaisheijastuksen rajakulma
määräytyy kahden aineen taitekertoimen mukaan. Kuten edellä
on jo todettu, aiemmin tunnettujen refraktometrien yhteydessä on ongelmana usein ollut optisen ikkunan kulmamuutokset laitteen runkoon nähden, koska optinen ikkuna on useissa ratkaisuissa kiinnitetty runkoon joustavan tiivistemateriaalin avulla. Joustavan materiaalin käyttö tiivisteenä
johtuu siitä, että mikäli optinen ikkuna on kiinnitetty

25

5

10

15

20

30

jäykästi runkoon, tiivistemateriaalin pitää olla hyvin elastinen ja näin ollen heikosti elastisia materiaaleja ei voida käyttää. Useissa tunnetuissa refraktometreissä optiikka ja valodetektori on kiinnitetty jäykästi runkoon, joten toisen ongelman on aiheuttanut rungon vääntymisestä aiheutuva kulmamittauksen virhe.

Edellä esitetyt tunnetun tekniikan epäkohdat on pystytty eliminoimaan keksinnön mukaisen refraktometrin avulla. Keksinnön mukaisessa refraktometrissä on olennaisena seikkana se, että valolähde 1, optinen ikkuna 2, välineet sädekimpun ohjaamiseksi ja valodetektori 4 on sovitettu jäykkään analysaattorimoduliin 5. Optinen ikkuna voi olla esimerkiksi prisma. Analysaattorimoduli 5 on sovitettu kelluvasti runkorakenteen ja optisen ikkunan 2 väliin sovitetun tiivistyksen 6 varaan. Tiivistys voi olla esimerkiksi kartiotiivistys tai se voi muodostaa esimerkiksi pallopinnan jne. Koska analysaattorimoduli 5 kelluu laitteen runkorakenteeseen ja muuhun mekaniikkaan nähden tiivistyksen 6 varassa, eivät ulkoiset voimat, kuten prosessinesteen virtauksesta aiheutuvat voimat, mekaaniset jännitykset putkistossa, lämpölaajeniminen ja paine, vaikuta mittauksen tarkkuuteen. Kelluvan analysaattorimodulin 5 ansiosta voidaan prisman tiivistyksessä 6 käyttää myös heikosti elastisia materiaaleja kuten teflonia.

Analysaattorimoduli 5 puristetaan jousielinten 7 avulla tiivistystä 6 vasten, jolloin puristusvoima on vakio kaikissa lämpötiloissa. Näin ollen jousielimet 7 kelluvan analysaattorimodulin 5 kanssa kompensoivat tiettyjen tiivistemateriaalien heikon elastisuuden. Jousielimet 7 on asennettu siten, ettei prosessilämpöä kulje niiden kautta analysaattorimoduliin 5.

Kelluva analysaattorimoduli 5 on yhteydessä prosessinesteeseen 3 ja runkorakenteen kärkeen 8a, ts. runkorakenteen siihen osaan, joka on kosketuksissa prosessiin, ainoastaan optisen ikkunan 2 kautta. Liitäntäpinta proses-

35

30

5

10

15

20

siin ja runkorakenteen kärkeen on minimoitu lämmönjohtumisen estämiseksi. Optisen ikkunan 2 ja ja kärjen välissä on tiivistys 6. Liitäntäpinnan tulee mahdollistaa pienet kulmamuutokset analysaattorimodulin akselin ja kärjen akselien välillä. kuten edellä on todettu, tiivistyksen liitäntäpinta voi olla esimerkiksi kartiomainen tai pallomainen. Kelluvan analysaattorimodulin 5 ansiosta myös laitteen valmistus ja huolto on helppoa. Analysaattori voidaan testata jo ennen varsinaista liittämistä muuhun mekaniikkaan.

Prosessimittalaitteissa joudutaan minimoimaan lämmön siirtyminen prosessista elektroniikkaan ja muihin lämpöherkkiin komponentteihin ja toisaalta maksimoimaan näiden osien jäähdytys. Tarkka pitoisuusmittaus vaatii myös tarkan ja nopean prosessinesteen lämpötilamittauksen. Keksinnön mukaisessa refraktometrissä lämpö siirtyy sekä runkorakenteen että analysaattorimodulin kautta elektroniikalle. Runkorakenteen kautta tapahtuva lämmönjohtuminen on estetty ohentamalla kärjen 8a seinämävahvuutta ja asettamalla lämpöeriste 9 kärjen 8a ja muun runkorakenteen, esimerkiksi kansiosan 8b väliin. Sopiva materiaali lämpöeristeelle 9 on esimerkiksi teflon.

Analysaattorimoduliin 5 pääsee johtumalla lämpöä ainoastaan optisen ikkunan 2 ja tiivistyksen 6 kautta. Kärjen 8a seinämien kautta tulee säteilylämpöä. Analysaattorimodulin 5 kautta tapahtuva lämmön siirtyminen elektroniikalle on estetty erillisellä jäykällä eristeosalla 10, joka on osa analysaattorimodulia. Eristeosan 10 tulee olla jäykkä, joten esimerkiksi tietyt keraamit ovat sopivia eristeitä.

Analysaattorimodulin 5 eristeosan 10 läpi pääsevä lämpö johdetaan tehokkaasti runkorakenteeseen joustavalla, esimerkiksi levymäisellä lämpöjohteella 11. Analysaattorimodulin 5 ja runkorakenteen väliin sovitettava lämpöjohde 11 on hyvin lämpöä johtavaa materiaalia, esimerkiksi kuparia tai alumiinia ja sen rakenne sallii analysaattorimodu-

10

15

20

25

30

35

lin 5 akselin suuntaisen liikkeen. Lämpö johdetaan runkorakenteesta laitteen ympäristöön runkorakenteen suuren ulkoisen pinta-alan avulla. Runkorakenteen ulkoista pinta-alaa voidaan kasvattaa esimerkiksi kansiosan 8b sopivan rivoituksen avulla kuten kuvioissa on esitetty.

Keksinnön mukaisen refraktometrin yhteydessä voidaan prosessinesteen lämpötilan mittaus suorittaa erityisen edullisella tavalla. Prosessinesteen lämpötila mitataan sähköisen lämpötila-anturin 12 avulla. Lämpötila-anturin 12 lämpökontakti kärjen 8a suuntaan on maksimoitu ja muun mekaniikan suuntaan minimoitu. Lämpötila-anturi 12 on eristetty analysaattorimodulista 5 sopivan eristemateriaalin, esimerkiksi teflonin avulla. Lämpötilamittauksen nopeuteen vaikuttaa anturin massan lisäksi myös kärjen 8a massa. Riittävän nopean lämpötilamittauksen aikaansaamiseksi kärjen massa voidaan jakaa kahteen erilaiseen osaan. Lämpötila-anturi on suorassa kontaktissa kevyemmän osan kanssa. Pienen ja suuren osan välistä lämmönjohtumista voidaan pienentää ohentamalla seinämää kärjen mekaanista puristusjäykkyyttä heikentämättä.

Keksinnön mukainen refraktometri asennetaan normaalisti päävirtaukseen, eli se on ns. in-line mittalaite. Optisen mittausmenetelmän vuoksi optisen ikkunan tulee pysyä puhtaana. Laitteen asennuspaikka on tärkeä puhtaanapysymisen kannalta. Putkistoissa, joissa virtausnopeus on suhteellisen suuri, putkiston mutkat pysyvät puhtaana. Näin ollen keksinnön mukaisen laitteen asennuspaikaksi on edullista valita juuri putken mutka. Mikäli putkikoko on pieni, voidaan käyttää erityistä virtausastiaa 13, joka asennetaan putken vakiomutkan tilalle. Kuviossa 3 on esitetty tällainen virtausastia. Virtausastia koostuu puolipallosta, jonka keskipisteenä on mittalaitteen optinen ikkuna. Virtausastian tulo- ja lähtöputket 14, 15 on kohdistettu puolipallon keskipisteeseen ja keskenään 90 asteen kulmaan. Mikäli virtauksen aiheuttamaa puhdistusvaikutusta halutaan lisätä,

5

10

15

tuloputkea 14 voidaan hieman supistaa kuten kuvion 3 esimerkissä on tehty. Virtausastia on itsetyhjentyvä kun se asennetaan kuvion 3 mukaiseen asentoon. Virtaustekniikan kannalta tulo- ja lähtöputken liittäminen puolipalloon on helppoa, koska pallon ja sylinterin liitäntäpinta on ympyrä.

Keksinnön mukainen refraktometri voidaan asentaa suurehkoihin putkiin kuvion 4 mukaisella tavalla putken mutkan 16 kohdalle. Keksinnön mukainen refraktometri voidaan luonnollisesti asentaa myös suoraan putkeen 17 kuten kuviossa 5 on esitetty. Prosessinesteen virtaussuunnat on merkitty kuvioihin 3 - 5 nuolten avulla.

Edellä esitettyjä sovellutusesimerkkejä ei ole mitenkään tarkoitettu rajoittamaan keksintöä, vaan keksintöä voidaan muunnella patenttivaatimusten puitteissa täysin vapaasti. Näin ollen on selvää, että keksinnön mukaisen refraktometrin ei välttämättä tarvitse olla juuri sellainen kuin kuvioissa on esitetty, vaan muunlaisetkin ratkaisut ovat mahdollisia.

Patenttivaatimukset:

5

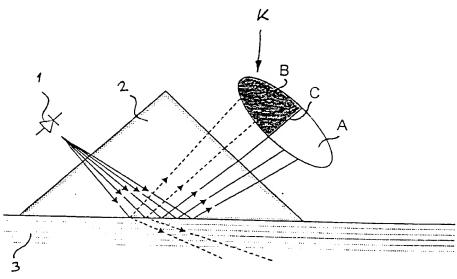
10

15

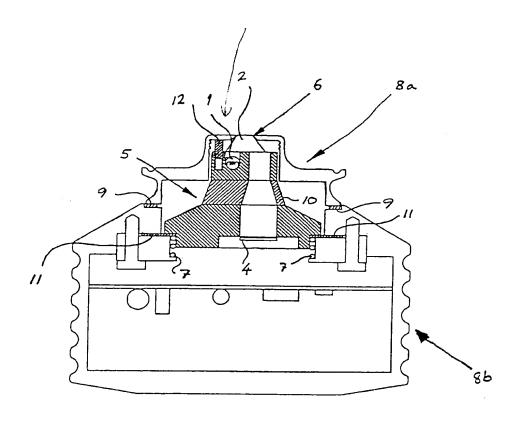
20

25

- 1. Refraktometri, joka käsittää runkorakenteeseen sovitetun valolähteen (1), prosessiliuokseen (3) sijoitettavan optisen ikkunan (2), välineet sädekimpun ohjaamiseksi valolähteeltä optisen ikkunan (2) ja prosessiliuoksen (3) rajapintaan, jolloin osa sädekimpusta imeytyy osittain liuokseen (3) ja osa heijastuu kokonaan takaisin liuoksesta (3) muodostaen kuvan (K), jossa valoisan (A) ja pimeän alueen (B) rajan (C) paikka riippuu prosessiliuoksen (3) taitekertoimesta sekä valodetektorin (4), jolla tarkastellaan edellä mainitulla tavalla muodostunutta kuvaa (K), tunnettu siitä, että valolähde (1), optinen ikkuna (2), välineet sädekimpun ohjaamiseksi ja valodetektori (4) on sovitettu jäykkään analysaattorimoduliin (5), joka on sovitettu kelluvasti runkorakenteen ja optisen ikkunan (2) väliin sovitetun tiivistyksen (6) varaan.
 - 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen refraktometri, t u n n e t t u siitä, että analysaattorimoduli (5) on sovitettu puristettavaksi tiivistystä (6) vasten jousielinten (7) avulla.
 - 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen refraktometri, tunnet tuusiitä, että runkorakenne on muodostettu kärkiosasta (8a) ja kansiosasta (8b) ja että kärkiosan (8a) ja kansiosan (8b) väliin on sovitettu lämpöeriste (9).
 - 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen refraktometri, tunnettu siitä, että analysaattorimoduliin (5) on sovitettu jäykkä, lämmön johtumista estävä eristeosa (10).
 - 5. Patenttivaatimuksen 3 tai 4 mukainen refraktometri, t u n n e t t u siitä, että analysaattorimodulin (5) ja kansiosan (8b) väliin on sovitettu lämpöjohde (11).
 - 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen refraktometri, tunnettu siitä, että lämpöjohde (11) on analysaattorimodulin (5) aksiaalisuunnassa joustava osa.



KUV. 1



KUV. 2

